

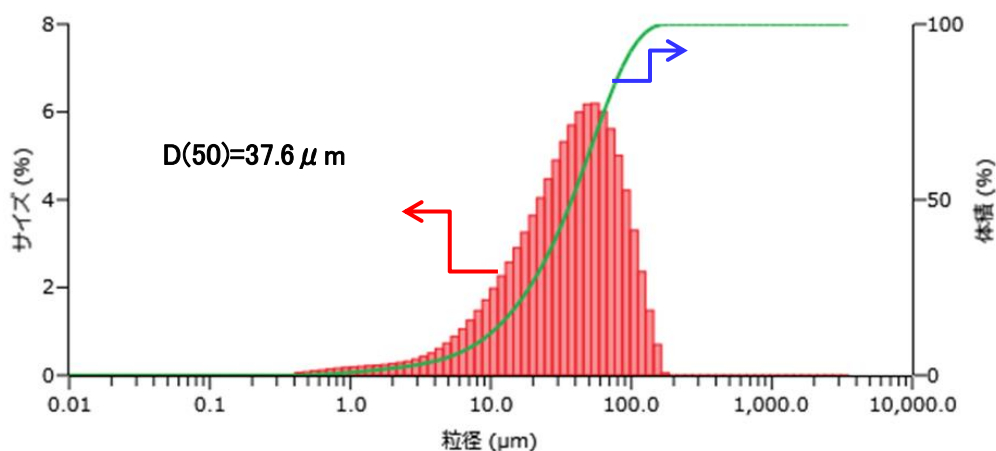
粒度分布測定装置（R 1629に準拠）JIS



設置 年度	2018年度
型 式	マスターサイザー3000
製 造 所	スペクトリス社（マルバーン・バナリティカル事業部）
仕 様	<ul style="list-style-type: none"> 測定範囲：0.01～3500 μm 精度：1%以内 再現性：（連続測定時） 0.5%以内 （指定サンプル使用時）1%以内 測定原理：Mie理論に基づくレーザー回折・散乱法 測定時間：0.1秒以上、0.1秒ごとの任意設定
用 途	液体に分散した粒子をレーザー回折と散乱の併用により粉体の粒度分布を測定する。

事例紹介

炭化ケイ素（純度 97%、粒度200F）



炭化ケイ素（純度 97%、粒度1200F）

